

Альтами МЕТ ЗТ микроскоп для микроэлектроники



Цена:

Цена по запросу

Описание

Методы контрастирований в отраженном свете:	<ul style="list-style-type: none">• светлое поле;• темное поле;• поляризация.
---	---

Увеличение (доступные значения):	50X-1600X (50X, 80X*, 100X, 160X*, 200X, 320X*, 400X, 500X, 600X*, 640X*, 800X, 960X*, 1000X, 1200X*, 1280X*, 1600X, 2000X*).
Окуляры:	<ul style="list-style-type: none">• WF10X/22 мм;• WF10X/22 мм с перекрестием и шкалой (100 делений);• WF16X/15 мм*;• WF20X/12 мм.

<p>Эпи-план ахроматические объективы для светлого и темного поля с увеличенными рабочими расстояниями, скорректированные «на бесконечность» (ICCOS L PLAN):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PL L 5X/0.12 BD ∞/0 (рабочее расстояние 9.7 мм); • PL L 10X/0.25 BD ∞/0 (р. р. 9.3 мм); • PL L 20X/0.40 BD ∞/0 (р. р. 7.2 мм); • PL L 40X/0.60 BD ∞/0 (р. р. 3.0 мм) (подпружиненный)*; • PL L 50X/0.70 BD ∞/0 (р. р. 2.5 мм) (подпружиненный); • PL L 60X/0.70 BD ∞/0 (р. р. 1.9 мм) (подпружиненный)*; • PL L 80X/0.80 BD ∞/0 (р. р. 1.2 мм) (подпружиненный); • PL L 100X/0.85 BD ∞/0 (р. р. 0.2 мм) (подпружиненный)*.
<p>Насадка:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • тринокулярная с наклоном 30°; • отдельный выход для подключения устройств захвата изображения; • диоптрийная подстройка ± 5 диоптрий; • изменяемое межзрачковое расстояние 53-75 мм.

	<ul style="list-style-type: none"> система освещения Epi-Kohler с регулируемыми апертурной и полевой диафрагмами; колесо со светофильтрами (синий, зеленый, желтый, матовый); источник освещения галогенная лампа, 12 В/50 Вт; возможность комплектации LED осветителем для полупрозрачных объектов.
Предметный столик:	<ul style="list-style-type: none"> прямоугольный двухкоординатный 280x270 мм; диапазон перемещений 204x204 мм.
Фокусировка:	<ul style="list-style-type: none"> коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; встроенный механизм для защиты объекта и объектива при быстрой смене; регулировка жесткости хода; шаг точной фокусировки 0.008 мм.

Цифровая камера:	<ul style="list-style-type: none"> • цветная CMOS 3 Мпикс (возможно укомплектовать другой камерой на выбор).
Программное обеспечение:	Altami Studio — программа для управления устройствами захвата изображения с возможностью проведения измерений, анализа и обработки изображений как на статичном изображении, так и на видеопотоке с камеры в онлайн-режиме.

Основные достоинства

- Предназначен для работы в отраженном свете, в светлом и темном поле, а также по методу простой поляризации
- Эпи-план ахроматические объективы для светлого и темного поля с увеличенными рабочими расстояниями, скорректированные «на бесконечность» (ICCOS L PLAN): 5X/0.17, 10X/0.25, 20X/0.40, 50X/0.70, 80X/0.8
- Большой удобный стол размерами 280×270 мм и диапазоном перемещений 204 x 204 мм — отличный инструмент для работы с квартцевыми пластинами, интегральными микросхемами и печатными платами больших размеров
- Возможность установки светодиодного осветителя для работы с полупрозрачными объектами
- Укомплектован цифровой камерой и программным обеспечением с функциями измерений объектов интереса, получения панорамного изображения и др